

# ナノテクノロジープラットフォーム

## 研究支援に提供する設備一覧

### 【微細構造解析プラットフォーム】

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
名古屋大学	反応科学超高压走査透過電子顕微鏡	日本電子製 JEM 1000K RS 加速電圧: 1000, 800, 600, 400kV 高真空中と共に0.13気圧までの ガス環境中で観察・EELSが可能 3D観察が容易に可能	
名古屋大学	電界放出走査透過電子顕微鏡	日本電子製EM-10000BU 照射レンズ系、結像レンズ系のそれぞれに収差補正機能を搭載 加速電圧: 200,80kV TEM, STEM, EDS, EELS 電子線ホログラフィー	
名古屋大学	電界放出透過電子顕微鏡	日立製HF-2000 加速電圧: 200kV 電子線ホログラフィー専用 酸素、水素ガス導入可 磁気シールドレンズを用いると磁性材料を観察可(最大50万倍)	
名古屋大学	電子分光走査透過電子顕微鏡	日本電子製JEM2100M 加速電圧: 200kV EELS、波長分散X線分光器(WDX) カソードルミネッセンス(CL) 100K-1000Kの温度範囲で計測可	
名古屋大学	集束イオンビーム加工機	日立製FB-2000 加速電圧: 40kV マイクロサンプリング、CAD機能	
名古屋大学	高分解能分析電子顕微鏡	日本電子製 JEM-2010F 加速電圧: 80/120/160/200kV 分解能 TEM: 0.19nm 元素分析: EDX	
名古屋大学	走査電子顕微鏡	FEI製 Quanta200FEG 加速電圧: 0.2~30kV 2次電子像分解能: 2nm 元素分析: EDX	
名古屋大学	アルゴンイオン研磨装置	Gatan製:PIPS II アルゴンイオン研磨装置	
名古屋大学	試料作製装置群	切断、機械研磨、化学研磨、FIB用サンプル加工等、無機材料系試料作製のための各種装置	
名古屋大学	高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡	日本電子製JEM-ARM200(Cold) 照射レンズ系に収差補正機能を搭載 加速電圧: 200,80kV TEM, STEM, EDS, EELS 電子線ホログラフィー	
名古屋大学	高速加工観察分析装置 (FIB-SEM)	日立ハイテクサイエンス製 MI-4000L 加速電圧: 30kV (FIB, SEM) マイクロサンプリング機能 FE-SEM、EDS およびEDSD機能	